# HIGH GRADIENT AND HIGH YIELD RECIPE FOR SINGLE-CELL SRF CAVITIES

### Fumio Furuta<sup>1</sup>, Kenji Saito KEK, High Energy Accelerator Research Organization 1-1 Oho, Tsukuba 305-0801, Japan

#### Abstract

KEKでは、ICHIRO形状の単セル超伝導空洞による50MV/m高電界達成の原理実証を行った。同時に、歩留まり よく高電界を達成するための表面処理レシピの改善を行ってきた。実際の加速器に用いる空洞と同様に、エンドグ ループ(高調波(HOM)減衰器やインプットカプラーポート)を持った単セル空洞(エンドシングルセル)ではそれまでの エンドグループ無しの空洞に対するレシピでは高電界を達成できなかった。本報告では、エンドシングルセルに対す る高電界レシピの改善、特にエタノール洗浄とワイピングのシリーズテストについて述べる。

# 単セル超伝導空洞による50MV/m高電界レシピ

## 1. はじめに

我々はニオブ超伝導空洞による50MV/m級高電界 の実証を目指した研究を進め、KEK-LL形状 (ICHIRO) の単セル空洞 (IS空洞) で50MV/mの原理 実証をした [1]。IS空洞はICHIRO-9セル空洞のレ ギュラーセル(2~8番目のセル)形状を持つ。ICHIRO 型9セル空洞 (I9空洞) では、ストレートビームパイ プ(BP)の付いたbare cavity 0号機(I9#0) で30MV/m、 実機型のエンドグループを持つfull cavity 1号機 (I9#1) で19MV/mに電界が制限された。この制限理 由の一つはエンドグループにあることが9セル空洞 の試験から分かった[2]。エンドグループとは空洞両 端のビームパイプ(BP)、及び高次モード取り出し用 ポート(HOM)や大電力入力結合器用ポート(Input port)、RFモニタピックアップ用ポートの部分のこと を言う。そこでエンド部の改善を施したNew-ICHIRO型9セル空洞(New-I9空洞)の設計を行うと共 に[3]、エンドグループ形状をもつ単セル空洞(ISE空 洞)を製作・試験し、問題の洗い出しと解決を図っ た。本報告ではISE空洞の高電界達成に向けたレシ ピ改善、特に複雑な構造をもつエンドグループへの 洗浄強化のシリーズテスト結果について述べる。

## 2. ISE空洞での高電界実証

2.1 レギュラー単セル空洞について得られた50MV/m レシピ

我々は単セル空洞で50MV/mの原理実証した後、 性能のばらつきを改善することに取り組んできた。 ばらつきの原因は電解研磨(EP)中に発生する硫黄 汚染にあると推測し、ニオブ表面での硫化ニオブ (Nb<sub>x</sub>S<sub>y</sub>)の形成と拡散というモデルを立てた[2]。この Nb<sub>x</sub>S<sub>y</sub>の除去は高圧超純水洗浄(HPR)や単純な洗浄強 化ではできず、新液を空洞内に閉じ込めて3μmのみ電 解研磨するFlash EPが最も効果的であった。ただし汚染 量は初期EP量に依存し、多量研磨の後ではFlash EPの みでの汚染除去は不完全である。IS空洞(図1)に対して ILCのACD目標(40MV/mでQ値>0.8e10)を保証する KEK-LLレシピは、遠心バレル研磨(CBP)+化学研磨 (CP10µm)+真空熱処理(AN、750℃\*3時間)+電解研 磨 (EP、80µm+20µm)+Flash EP(3µm)+ 脱脂洗浄 (Degreasing)+HPR+ベーキング(Baking) である。

#### 2.2 New-ICHIRO形状ISE空洞の高電界実証

新たに設計・製作したNew-ICHIRO形状ISE空洞 (図1)のうちbare cavity型のISE#3についてはIS空洞と 同じレシピで50MV/mを達成し、エンドセルRF形状 に問題が無いことを実証した(図2)。だが、エンド グループ付きのISE#4 (HOMシリンダーのみの simple end-group付き単セル)で 18MV/m、ISE#5 (HOMアンテナ含むfull end-group付き単セル)で 33MV/m、にフィールドエミッション(FE)でそれぞ れ制限された。これはエンドグループのような複雑 な構造に対してEP中の硫黄汚染が除去しづらい事を 意味する。そこで硫黄を溶解できるエタノール洗浄 をEP直後に取り入れることを試みた。その結果、 ISE#4 で 52MV/m、ISE#5 で 40MV/mを達成した (ISE#5は現在48MV/mまで到達している)(図2)。 これによってエンドグループのような複雑な構造に

ンポームのマンドクルークのような後継な構造に対する汚染除去の困難さの問題を理解し、エタノール洗浄の効果を確認出来た。



IS: レギュラーセル形状、ISE:エンドセル形状

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: fumio.furuta@kek.jp



## 3. エタノール洗浄によるシリーズテスト

エタノール洗浄の効果の確認後、+EP(20µm) +flash EP(3µm) + Ethanol rinse + Degreasing + HPR + Baking +測定、をISE#4に対し5回、ISE#5に対し6回繰り返して、 歩留まり試験をした。結果を図3にそれぞれ示し、このシ リーズテストで明らかになった問題を以下に述べる。

### 3.1 HOMに対するベーキング効果

前述のISE#4で52MV/mを達成した際、ベーキングは セル部分のみであった。ISE#5にも同様のベーキングを 行った。ISE#5の初めの3回のシリーズテストで電界は40、 40、31MV/mに制限された。その原因はHOMアンテナ のベーキング不足にあると考え、ISE#5の4~6回目のシ リーズテストではHOMを含めた空洞全体をベーキングし た。その結果45、34、45MV/mを達成した。HOMアンテ ナに対してもベーキングによる表面酸素の拡散を十分 行う必要性を確認した。9セル空洞では空洞全体をベー キングチャンバーに入れてベークするため、この問題は 起きない。

### 3.2 40MV/m以上でのQ-slope

ISE#4の歩留まり試験では40MV/m以上の高電界に おけるQ-slopeが顕著であった(図3)。エンドグループを 持たないIS空洞ではこのようなものは見られず、高電界 Q-slopeはエンドグループに原因があると考えた。この原 因として、ISE#4のHOMシリンダーは行き止まりの構造の ため洗浄が不十分であることが疑える。脱脂、HPR等の 追加洗浄を図ったがQ-slope改善は出来なかった。これ はISE#4のシリンダー構造にも問題がある可能性を考え、 full end-group付きのISE#5へと持ち越した。

## 4. ワイピングによるシリーズテスト

## 4.1 ワイピング

エタノール洗浄のシリーズテストで、ISE#5は高電界Qslopeをみるには到達電界の平均値が39MV/mと低く顕 著ではなかった。またQ-slopeの問題に加え、ISE#4、#5



ともに性能のばらつきが10%、15%と大きかった。これら を改善するためにHOMシリンダー、アンテナ汚染に対 する汚染除去強化のpilot studyをISE#5で行った。その 中で脱脂やエタノール、HPRでは取れない汚染が発生 し、空洞性能を著しく悪化させた。そこで機械的に表面 汚染を除去するワイピングを試みた。これは滑らかな清 浄布+脱脂剤で空洞内表面をこすり洗いするものである (図4)。結果、10MV/mレベルのFEが30MV/mでクエンチ リミットするところまで改善し(図5)、しつこい表面汚染の 除去手段としてワイピングに期待を持つ結果となった。

4.2 EP+エタノール+ワイピングの歩留まり試験



現在、ISE#4、ISE#5に対し+EP (20µm) +flash EP (3µm) + Ethanol rinse + Wiping + HPR + Baking+測定 のシリーズテストを行っている。現在、ISE#4で3回、 ISE#5で5回行った。結果を図6にそれぞれ示す。ISE#4 では回数が少ないものの、再現性が非常に高くなった。 ISE#5では到達電界の平均値が10%上がると共に、O-



slopeが顕著になった。また40MV/mでのQ値を比較すると15%程度改善した(表1)。エタノール洗浄でも取りきれない汚染をワイピングによって除去することが性能改善に結びついたと言える。一方、Q-slope改善には有効ではなく、さらに対策が必要である。

## 5. 高電界Q-slope問題

ワイピングを入れることでfull HOM end-group(ISE#5) のQ-slope問題がより明確になった。考えられる要因とし てEP汚染の残留、HOM内部MP(マルチパクタ)、HOM チューニング、さらにHOMアンテナ材料などを考察し、 改善試験に取り組んだ。

HOMチューニングは単セルの共振周波数に対し



	EP+Ethanol		EP+Ethanol+Wiping	
	Eacc[MV/m]	Qo [e10]	Eacc[MV/m]	Qo [e10]
ISE#4	46.5±4.5	1.15±0.22	46.6±1.0	1.37±0.22
ISE#5	39.2±5.7	0.97±0.11	42.6±3.7	1.12±0.21

表1:Eacc、Q値の改善(Q値は40MV/mの値)

HOMアンテナがカップルしてしまい、HOMアンテナで発熱、Q-slopeを起こすことを懸念した。これはカップルしないようHOMをデチューニングすることで対処したが改善は無かった。

また、HOMアンテナの材料にはニオブの鍛造材を 使っておりこれが発熱面で不利と考え、高温アニール (950度\*3時間)による材料の再結晶化を行った。目 立った改善は無かったが、今後のエンドグループ製作 ではパーツの段階でアニールする手法をとることにした。

HOM内MPについては旧デザインのシミュレーション からHOMシリンダーとアンテナ間でのMPが予想され、 新デザインのHOMではMPが抑えられた構造になって いる [4]。ISE#5は旧HOMデザインなのでMPは懸念材 料であり、Q-slopeとの因果関係を明確にする必要がある。 またISE#4はシリンダーのみの構造でQ-slopeが起きてお り、シリンダーでのMPについてもつめる必要がある。

EP汚染に関しては硫黄汚染を除去する事後策に取り 組む一方で、硫黄発生を抑制する事前策を考えており、 汚染を根本的に解決するためのpilot studyを進めている。

## 6. 最後に

エンドシングルセルにおける高電界実証、及びISE空 洞用レシピ改善を行った。その中で複雑なエンドグルー プ構造の問題が明らかになった。汚染に対してはエタ ノール洗浄やワイピングによる洗浄強化による改善が見 られた。これらは9セル空洞のレシピに適用していく。新 たな問題として40MV/m以上でのQ-slopeが明らかに なった。この原因究明と、洗浄方法の再検討など現在の 手持ちの駒で改善策を見つけることに取り組んでいる。 また新デザインHOMを持つfull end-group付きISE空洞 による試験を準備しており、こちらからもQ-slope問題に 取り組む予定である。

## 参考文献

- [1] F. Furuta et al., Proc. 10<sup>th</sup> Eur. Part. Acc. Conf. (EPAC2006), Edinburgh, June 2006, p.750
- [2] K. Saito, Proc. of 13th International Workshop on RF Superconductivity, Peking University, Beijing, China 2007, TU202
- [3] Y. Morozumi et al., Proc. 22<sup>nd</sup> Part. Acc. Conf. (PAC07), Albuquerque, New Mexico, June 2007, p2439, p2575
- [4] Y. Morozumi, WG5-Asia Meeting on 16<sup>th</sup> February 2007, http://lcdev.kek.jp/ILC-AsiaWG/WG5notes/